

Journal of Electrochemistry

Volume 2 | Issue 2

1996-05-28

Electroluminescent Property of n Type Porous Si and Its Characterization by XPS and LIMA

Guozheng Li

Chenqian Zhang

Recommended Citation

Guozheng Li, Chenqian Zhang. Electroluminescent Property of n Type Porous Si and Its Characterization by XPS and LIMA[J]. *Journal of Electrochemistry*, 1996 , 2(2): Article 6.

DOI: 10.61558/2993-074X.3066

Available at: <https://jelectrochem.xmu.edu.cn/journal/vol2/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by Journal of Electrochemistry. It has been accepted for inclusion in Journal of Electrochemistry by an authorized editor of Journal of Electrochemistry.

n型多孔硅的电发光性能及其 XPS 和 LMA 表征

李国铮^{*} 张承乾

(山东大学化学系, 济南 250100)

张 强

(厦门大学化学系, 厦门 361005)

多孔硅(PS)的发光性能与其化学组成和结构的关系已为人们所关注 曾有人认为, 发光是由于纳米级多孔硅的量子限制效应所引起, 但一些实验结果表明其原因是 PS 表面含有硅烷类发光化合物 本文研究光电化学刻蚀形成的 n 型多孔硅的电致发光性能以及用 X-光电子能谱(XPS)和激光离子化微分析(LMA)方法对刻蚀产物进行表征, 试图寻找其相关性以理解电发光的原因并提供 PS 的组成和结构上的一些新信息

1 实验

1.1 材料 单晶(100)n-Si, 电阻率为 $5 \Omega \cdot \text{cm}$, 德国Wacker-chemicaltronic GmbH 产品

1.2 样品制备方法 将硅片在 40% HF 中刻蚀 3 min, 经重蒸馏水冲洗放入 2.5% HF 水溶液, 在溴钨灯照射下(电极表面处光强度为 60 mW/cm^2), 于不同的电位进行恒电位极化(文中电位皆相对于饱和甘汞电极(SCE)), 控制通电量为 10 C. 样品取出后, 经水和无水乙醇依次冲洗, 制成的刻蚀 n-Si 电极在空气中存放, 备以下测定应用, 详见文献[1].

1.3 发光光谱(ES)测定 用 Hitachi 850 荧光光谱仪 光谱测定池为三电极体系, 溶液为 0.2 M Na₂SO₄ + 0.1 M Na₂SiO₃, 刻蚀 n-Si 电极作工作电极, 铂片为对电极, SCE 为参比电极, 恒电位控制用 HDV-7 恒电位仪, 在室温和不同的阴极极化电位下, 以 450 nm/m in 的波长扫描速度记录 500~850 nm 范围内的 ES

1.4 XPS 测定 用 VG ESCA-LAB 能谱仪, 激发源是 Al K α 射线, 通能量为 50 eV, 用 C_{1s} 作内标校正

1.5 LMA 测定 用厦门大学研制的飞行时间质谱仪, 激光源为 Q-Switched DCR-11 ND: YAG 激光器, 波长取 532 nm, 脉冲间隔为 7 ns, 样品表面的激光功率约为 10^8 W/cm^2 , 光点直径 2 μm , 样品深度是 4~100 nm.

本文 1995-11-10 收到, 1995-12-25 收到修改稿; 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室资助
项目

2 结果和讨论

2.1 刻蚀n-Si的ES

当将刻蚀PS电极置于 $0.2\text{ M Na}_2\text{SO}_4 + 0.1\text{ M Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液中阴极极化(电位控制: -1.2~ -2.5 V vs SCE)时, 可立即看到电极发出的强橙色或绿色光, 但随极化时间增加而减弱, 这一电发光现象已较成功地由载流子注入机制解释^[3]。

图1是在不同电位下制备的刻蚀n-Si电极的ES, 谱带较宽, 发光强度(峰高或谱线积分值)与样品制备电位有关, 图2示出了在-0.05 V下制得的样品发光最强。图1还表明, ES峰波长随制备电位的变化不大; 而当极化电位负移时, 峰的波长向短波方向移动, 在更负电位下峰值变化减小, 将另文讨论。

图1 刻蚀n-Si电极在 $0.2\text{ M Na}_2\text{SO}_4 + 0.1\text{ M (NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 于-1.3 V下极化时的发射光谱
1) -0.2 V, 2) -0.1 V, 3) 0.0 V, 4) 0.1 V, 5) -0.05 V

Fig. 1 The ES of etched n-Si electrodes during cathodic polarization

图2 发光强度与PS制备电位的关系

Fig. 2 Relation between EL intensity and prepared potential of the samples

2.2 刻蚀n-Si的XPS和LMA表征

图3示出刻蚀n-Si的XPS。图中, 谱线0的峰值结合能 $E = 99.6\text{ eV}$, 表示化学刻蚀的硅表面仅存在零价Si或对应于Si-Si; 谱线1的 $E = 102.7\text{ eV}$, 表示在低极化下, II价Si已经形成; 对谱线2, $E_1 = 102.6\text{ eV}$, $E_2 = 103.8\text{ eV}$ 表示II~IV价含硅化物共存。以上能谱结果也可说明Mlemming的硅阳极溶解机构: 在较低阳极极化区, Si(II)有积累。



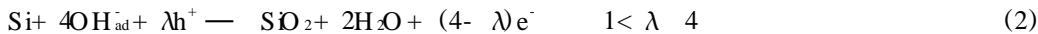


图 3 刻蚀 n-Si 的光电子能谱

0) 未极化, 1) - 0 2 V, 2) - 0 1 V, 3) 0 0 V
V

Fig. 3 XPS of etched n-Si

阳极电位正移时, 空穴浓度增加进而引发了更快的电化学反应:



此外, 从价态分析, 水在 PS 上吸附并发生如下化学反应也是可能的:



对谱线 3: 在 102~105 eV 之间, 可分解出 2~3 个峰, 表明 II~IV 的硅共价化合物品种更多。上述谱线 2 和谱线 3 与 Yan 等^[2]测得的硅烷 ($\text{Si}_n\text{O}_m\text{H}_x$) 谱图很近似 揭示了刻蚀 n-Si 的表面含有 $\text{Si}-\text{O}-\text{H}$ 类分子。

图 4 为刻蚀 n-Si 的 LMA 负离子质谱图 图中对 $m/e < 60$ 各种负离子, 除 28 (Si^-)、56 (Si_2^-) 外, 应归咎于碳质的表面沾染; 样品 1, 2 和 3 均被检测出种类较多和信号较强的团簇; 团簇的种类和强度, 取决于样品制备时的极化电位 其中 197 ($\text{Si}_5\text{O}_7\text{H}$), 181 ($\text{Si}_6\text{O}_6\text{H}$), 121 ($\text{Si}_4\text{O}_4\text{H}$), 105 ($\text{Si}_3\text{O}_3\text{H}$) 系类硅烷化合物, 符合通式: $\text{Si}_n\text{O}_{2n-1}\text{H}$, $\text{Si}_n\text{O}_{2n}\text{H}$, $\text{Si}_n\text{O}_{2n+1}\text{H}$, 上述团簇也曾在以 P-Si 为基的 PS 中检出过^[2]。出现在图 4-2 和图 4-3 中 $m/e = 302$ ($\text{Si}_{10}\text{O}_{10}\text{H}_2$) 和 318 ($\text{Si}_{11}\text{O}_{11}\text{H}_2$) 的团簇, 是检测到的最大团簇, 其分子式符合 $\text{Si}_{2n}\text{O}_{2n}\text{H} \cdot \text{Si}_{2n+1}\text{O}_{2n+1}\text{H}$ 。由图 2 可知, 样品 2 和 3 的发光强度较大似乎应归结于多孔硅表面含有较多的 302 和 318 团簇

图 4 刻蚀 n-Si 的质谱

1) - 0 2 V, 2) - 0 1 V, 3) 0 0 V, 4) 0 1 V

Fig. 4 Mass spectra of etched n-Si

Electroluminescent Property of n-Type Porous Si and Its Characterization by XPS and LMA

Li Guozheng Zhang Chenqian

(Department of Chemistry, Shandong University, Jinan 250100)

Zhang Qiang

(Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005)

Abstract The chemical composition and structure of electroluminescent porous Si (PS) on n-Si, prepared by photoelectrochemical etching method, were investigated by using XPS and LMA. The results show that electroluminescence (EL) intensity depends on the formation potential of PS. The relation between EL property and the results of XPS and LMA is also discussed.

Keywords Porous silicon, XPS, LMA, Electroluminescence

References

- 贾瑞宝, 王士勋, 李国铮 n^+ -Si在HF溶液中的阳极极化行为和阻抗谱. 化学学报, 1995, 53: 417~424
- Yau S, A rendt M, Bard A J et al. Study of the structure and chemical nature of porous Si and silaxene by STM, AFM, XPS, and LMA. *J. Electrochem. Soc.*, 1994, 141: 402~409
- Searson P C, Prokes S M, Glembocki O J. Luminescence at the porous silicon/electrolyte interface. *J. Electrochem. Soc.*, 1993, 140: 3327~3331